

Résumé :

Ce travail consiste à contrôler et à mesurer la rugosité des films minces de TiO₂, recuites à une température de 400°C pendant des intervalles de temps différents, en utilisant la méthode de la transformée de Fourier rapide (FFT).

L'analyse des échantillons sera réalisée en utilisant un profilomètre optique combiné à un logiciel d'analyse des interférogrammes capturés. Ainsi le profil de surface des échantillons peut être obtenu en cherchant la FFT des images acquises.

Afin d'assurer la validité de cette technique nous avons fait une comparaison de ses résultats avec ceux de la AFM.

Mots clés :

Interférométrie, rugosité, FFT, profilométrie, AFM